JP3,323,919

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-105818

(43)Date of publication of application: 23.04.1996

(51)Int.CI.

G01M 11/02 G02B 6/00 G02B 6/36

(21)Application number: 06-241351

(71)Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

05.10.1994

(72)Inventor:

SASAKURA KUNIHIKO

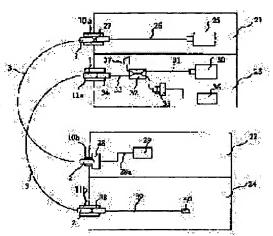
NAGAYAMA AKIRA

(54) APPARATUS FOR AUTOMATICALLY MEASURING OPTICAL CHARACTERISTIC OF OPTICAL CONNECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To make possible automatic measurement of a connection loss and loss in reflection by arranging a robot hand mechanism which grasps an optical connector mounted at both ends of an optical cord to perform a three-dimensional transfer, a control part, an optical characteristic measuring device and an input/output interface thereof.

CONSTITUTION: Prior to automatic measurement of optical characteristic, a master optical connector 27 is connected to a photodetector 28 with a receptacle for measuring a connection loss through an optical cord 3 having optical connectors 1 and 2 at both ends and the current value obtained is set as reference value of the connection loss. A master optical connector 34 for measuring a reflection loss is exposed to air to set a reference value. In the measuring of the connection loss, a light output section 21 for measuring the connection loss and a photodetecting part 22 are used. The connector 27 or the like is connected to an optical output interface 10a for measuring the connection loss and the photodetector 28 is arranged at a photodetecting interface 10b for measuring the connection loss. To measure a reflection attenuation value, a light outputting/photodetecting part 23 for measuring the reflection attenuation value and a termination part 24 for measuring the reflection attenuation value are used.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3323919

[Date of registration]

05.07.2002

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第3323919号 (P3323919)

(45)発行日	平成14年9	月9日	1 (2002.	9.9)
---------	--------	-----	----------	------

(24)登録日 平成14年7月5日(2002.7.5)

(51) Int.Cl. ⁷		微別記号	FΙ		
G01M	11/02		G 0 1 M	11/02	J
					Z
G 0 2 B	6/00		G 0 2 B	6/00	Α
	6/36			6/36	

請求項の数4(全 10 頁)

(21)出願番号	特顧平6-241351	(73)特許権者	000004226
			日本電信電話株式会社
(22)出顧日	平成6年10月5日(1994.10.5)		東京都千代田区大手町二丁目3番1号
		(72)発明者	笹倉 久仁彦
(65)公開番号	特開平8-105818		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
(43)公開日	平成8年4月23日(1996.4.23)		日本電信電話株式会社内
審查請求日	平成11年10月8日(1999.10.8)	(72)発明者	永山 昭
			東京都千代田区内幸町一丁目1番6号
			日本電信電話株式会社内
		(74)代理人	100064414
			弁理士 磯野 道造
		審査官	菊井 広行
		шдр	A) [[]
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光コネクタの光学特性自動測定装置

-

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】光通信用の光コネクタの接続損失と反射減 衰量を測定する光コネクタの光学特性自動測定装置であって、

接続損失測定用光出力インタフェースを備える接続損失測定用の光出力部と、接続損失測定用受光インタフェースを備える接続損失測定用の受光部と、反射減衰量測定用光出力インタフェースを備える反射減衰量測定用の光出力・受光部と、反射減衰量測定用終端インタフェースを備える反射減衰量測定用の終端部とを有する第1の光10学特性測定器と、

測定対象である光コードの両端に取付けられた第1の光 コネクタと第2の光コネクタを把持して3次元的に移送 し、前記接続損失測定用の各インタフェースに前記第 1、第2の光コネクタをそれぞれ挿入・抜去する、また 2

は前記反射減衰量測定用の各インタフェースに前記第 1,第2の光コネクタをそれぞれ挿入・抜去するように 動作するロボットハンド機構部およびその制御部とを有 し、

前記接続損失測定用の光出力部は、接続損失測定用光源と、一端に接続損失測定用のマスタ光コネクタを有する接続損失測定用のマスタ光コードとをさらに備え、前記接続損失測定用のマスタ光コネクタは前記接続損失測定用光出力インタフェースに接続され、前記接続損失測定用のマスタ光コードの他端は前記接続損失測定用光源に接続され、

前記接続損失測定用の受光部は、接続損失測定用の受光 素子と、この接続損失測定用の受光素子の出力を測定す るための第1の出力測定器と、接続コードとをさらに備 え、前記接続損失測定用の受光素子は前記接続損失測定 3

<u>用受光インタフェースに配置され、かつ、前記接続コー</u> ドを介して前記第1の出力測定器に接続され、

前記反射減衰量測定用の光出力・受光部は、反射減衰量 測定用光源と、光コードと、2つの入力端と2つの出力 端とを有する光ファイバカプラと、一端に反射減衰量測 定用のマスタ光コネクタを有する反射減衰量測定用のマ スタ光コードと、反射減衰量測定用の受光素子と、この 反射減衰量測定用の受光素子に接続されてとの反射減衰 量測定用の受光素子の出力を測定するための第2の出力 測定器と、斜め研磨光コネクタとをさらに備え、前記光 ファイバカプラの入力端の一つには前記光コードを介し て前記反射減衰量測定用光源が接続され、かつ、他の入 力端には反射減衰量測定用の受光素子が接続され、前記 光ファイバカブラの出力端の一つには前記反射減衰量測 定用のマスタ光コードの他端が接続され、かつ、他の出 力端は前記斜め研磨光コネクタで無反射終端され、前記 反射減衰量測定用のマスタ光コネクタは前記反射減衰量 **測定用光出力インタフェースに接続され、**

前記反射減衰量測定用の終端部は、一端に低反射光コネクタを有し他端が斜め研磨光コネクタで終端されている無反射終端光コードをさらに備え、前記低反射光コネクタは前記反射減衰量測定用終端インタフェースに接続され、

前記第1の光学特性測定器を用いて前記第1および第2の光コネクタの接続損失と反射減衰量を自動測定するととを特徴とする光コネクタの光学特性自動測定装置。

【請求項2】前記接続損失測定用光出力インタフェースと前記反射減衰量測定用光出力インタフェースとが一体となるように配置され、かつ、前記接続損失測定用受光インタフェースと前記反射減衰量測定用終端インタフェ 30 ースとが一体となるよう配置され、一体化された前記接続損失測定用光出力インタフェースおよび前記反射減衰量測定用光出力インタフェースと、一体化された前記接続損失測定用受光インタフェースと、一体化された前記接続損失測定用受光インタフェースとび前記反射減衰量測定用終端インタフェースとの機械的位置を交替させる手段をさらに具備したことを特徴とする請求項1に記載の光コネクタの光学特性自動測定装置。

【請求項3】前記第1,第2の光コネクタの端面を清掃する端面クリーナを<u>さらに</u>具備したことを特徴とする請求項1<u>または</u>請求項2に記載の光コネクタの光学特性自動測定装置。

【請求項4】前記第1の光学特性測定器と同一構成を有する第2の光学特性測定器をさらに有し、かつ、使用する光学特性測定器を前記第1の光学特性測定器から前記第2の光学特性測定器へ、あるいは前記第2の光学特性測定器へ機械的に切り替える手段をさらに具備したことを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の光コネクタの光学特性自動測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、光通信に用いられる 光コネクタの光学特性自動測定装置に関するものであ る。・

[0002]

【従来の技術】光通信用の光コネクタでは、低損失でかつ低反射の光接続を保障するため、光コネクタの組立後、光学特性の測定が行われる。測定項目としては、光コネクタの接続部での光の透過率を示す接続損失と、反射率を示す反射減衰量とがあり、現在はこれらの接続損失と反射減衰量とを人手により個別に測定している。以下、図面を用いて従来の測定法を説明する。

【0003】図6の(a), (b)は光コネクタの接続 損失の測定法を説明する図である。この図において、4 1はLD光源、42はマスタ光コード、42 aは光コネ クタ、42 bはマスタ光コネクタである。ととで、マス タ光コネクタとは、機械的寸法精度および光学特性にす ぐれた基準光コネクタであり、たとえば、JISC 5961の 表2に記載されている光コネクタ(コア偏心量0.5 μ m以下、出射角0.2度以下、フェルール外径精度± 5 μ m以下等)相当のものを指す。43はアダプ タ、44は両端に光コネクタ付きの光コード、44aは 測定対象である光コネクタ、44bは終端側の光コネク タ、45は受光ユニット、46はパワーメータである。 【0004】まず、光コネクタの接続損失の測定に先立 ち、図6の(a)に示す測定系において、接続損失の基 **準設定を行う。マスタ光コード42の一端の光コネクタ** 42 aをLD光源41 に接続し、マスタ光コネクタ42 bを受光ユニット45に接続する。マスタ光コネクタ4 2 b からの出射光は、空気層を介して受光ユニット45 により受光される。 このマスタ光コネクタ42 b から出 射パワーPi0をパワーメータ46により読み取り、との 値を接続損失測定における基準値(接続損失を0)と規 定する。

【0005】次に、測定対象である光コネクタ44aの接続損失を測定するため、マスタ光コネクタ42bを受光ユニット45から取外した後、図6の(b)に示すように、マスタ光コネクタ42bと測定対象である光コネクタ44aをアダプタ43を介して接続し、終端側の光コネクタ44bは受光ユニット45に接続する。終端側の光コネクタ44bからの出射光は、基準値測定の時と同様に、空気層を介して受光ユニット45により受光される。この時の出射パワーPi1をパワーメータ46により測定する。

【0006】光コネクタの接続部での接続損失 I L は、前記出射パワーPi0、前記出射パワーPi1、光ファイパの伝送損失 α (dB/Km)、光コネクタの端面での反射損失 β を用いて次式で表される。

[0007]

50 【数1】

$$I_{\nu} = -10 \, \varrho \, \text{og} \, \frac{P \, i \, 1}{P \, i \, 0} - \alpha - \beta \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$$

【0008】とこで、光コネクタの端面での反射は、通 常0.01%以下であり、反射損失βは測定器の分解能 以下となるため考えなくてもよい。また、シングルモー ド光ファイバの場合は、伝送損失αは0.35dB/K m以下である。従って、測定対象とする光コードの長さ が30m以下の場合は、伝送損失αは測定器の分解能に 10 ほぼ等しい0.01dB程度となるため無視して差し支 えなく、30 m以上の場合も光ファイバの伝送損失(α /m)を予め測定もしくは計算しておけば、いずれの場 合も式(1)より光コネクタの接続損失 IL を簡単に求 めることができる。

【0009】次に、図7の(a), (b)を用いて反射 減衰量の測定法を説明する。この図において、50は安 定化LD光源、51は光方向性結合器、51a, 51b は光方向性結合器51の入力ポート、51c,51dは 光方向性結合器 5 1 の出力ポート、5 1 e, 5 1 f は入 20 力ポート用の光コネクタ、51g,51hは出力ポート 用の斜め研磨光コネクタ、52はマスタ光コード、52 aはマスタ光コード52に接続した斜め研磨光コネク タ、52bはマスタ光コード52に接続した反射減衰量 の測定用のマスタ光コネクタ、53はアダプタ、54は 反射減衰量を測定するための受光ユニット、55はパワ ーメータ、56はアダプタ、57は光コード、57aは 測定対象である光コネクタ、5 7 b は終端側光コネク タ、58はアダプタ、59は無反射終端光コード、59 aは無反射終端光コード59に接続した低反射光コネク*30

$$R_{L} = -10 \, \ell \, \text{og} \, \log \frac{P \, r1}{P \, r0}$$

【0013】終端側光コネクタ57bの反射減衰量の測 定も、同様に測定対象である光コネクタ57a,終端側 光コネクタ57bを前記アダプタ56,58からそれぞ れ取り外した後、前記アダプタ56を介して前記マスタ 光コネクタ52 b と測定対象である光コード57の終端 側光コネクタ57bとを接続し、前記測定対象である光 40 コネクタ57aをアダプタ58に接続替えし、パワーメ ータ55で指示値Praを測定することにより同様に求め ることができる。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これま での測定法では測定対象である光コネクタのアダプタへ の着脱、測定値から接続損失および反射減衰量の平均値 の算出、測定値の保存、統計処理が人手にたよっていた ため、検査コストが増大するといった欠点があった。と

*タ、59bは無反射終端光コード59に接続した斜め研 磨光コネクタである。

【0010】図7の(a)を用いて光コネクタの反射減 衰量の測定における基準値の測定法を説明する。光方向 性結合器51の入力ポート51aを安定化LD光源50 に接続し、他の入力ポート51bは反射減衰量を測定す るための受光ユニット54に接続する。次に、光方向性 結合器51の出力ポート51cをアダプタ53を介して マスタ光コード52と接続する。他の出力ポート51d は、この出力ポート51dから反射を抑止するため斜め 研磨光コネクタ51gで終端してある。 反射減衰量の基 準値には、光ファイバと空気間のフレネル反射が用いら れることが多い。この場合、マスタ光コネクタ52bを 空気にさらした時のパワーメータ55の指示値Proが基 準値となる。

【0011】次に、図7の(b)を用いて光コネクタの 反射減衰量の測定法を説明する。測定対象である光コネ クタ57aとマスタ光コネクタ52bをアダプタ56を 介して接続し、終端側光コネクタ57bもアダプタ58 を介して無反射終端光コード59の一端に取り付けられ た低反射光コネクタ59aと結合させる。この状態で、 光パワーメータ55の指示値Prを測定する。光コネク タの反射減衰量R」は、前記光パワーメータ55の指示 値Pr。 Pr.を用いて次式で表される。

[0012] 【数2】

 \cdots (2)

減衰量の測定を自動的に行う光コネクタの光学特性自動 測定装置を提供することを目的とするものである。

[0015]

【課題を解決するための手段】前記のような課題を解決 するために、請求項1に係る発明は、光通信用の光コネ クタの接続損失と反射減衰量を測定する光コネクタの光 学特性自動測定装置であって、接続損失測定用光出力イ ンタフェース 1 0 a を備える接続損失測定用の光出力部 21と、接続損失測定用受光インタフェース10bを備 える接続損失測定用の受光部22と、反射減衰量測定用 光出力インタフェース11aを備える反射減衰量測定用 の光出力・受光部23と、反射減衰量測定用終端インタ フェース11bを備える反射減衰量測定用の終端部24 とを有する第1の光学特性測定器と、測定対象である光 コード3の両端に取付けられた第1の光コネクタ1と第 の発明は、光コネクタの光学特性である接続損失と反射 50 2の光コネクタ2を把持して3次元的に移送し、前記接

<u>続損失測定用</u>の各インタフェース10a, 10b に前記 第1, 第2の光コネクタ1, 2をそれぞれ挿入・抜去す る、または前記反射減衰量測定用の各インタフェース 1 1a. 11bに前記第1, 第2の光コネクタ1, 2をそ れぞれ挿入・抜去するように動作するロボットハンド機 構部7.8およびその制御部(実施例における計算機1 3)とを有し、前記接続損失測定用の光出力部21は、 接続損失測定用光源25と、一端に接続損失測定用のマ スタ光コネクタ27を有する接続損失測定用のマスタ光 コード26とをさらに備え、前記接続損失測定用のマス 10 タ光コネクタ27は前記接続損失測定用光出力インタフ ェース10aに接続され、前記接続損失測定用のマスタ 光コード26の他端は前記接続損失測定用光源25に接 続され、前記接続損失測定用の受光部22は、接続損失 測定用の受光素子28と、この接続損失測定用の受光素 子28の出力を測定するための第1の出力測定器(実施 例におけるパワーメータ29)と、接続コード28aと をさらに備え、前記接続損失測定用の受光素子28は前 記接続損失測定用受光インタフェース10bに配置さ れ、かつ、前記接続コード28aを介して前記第1の出 20 力測定器に接続され、前記反射減衰量測定用の光出力・ 受光部23は、反射減衰量測定用光源30と、光コード 31と、2つの入力端と2つの出力端とを有する光ファ イバカプラ32と、一端に反射減衰量測定用のマスタ光 コネクタ34を有する反射減衰量測定用のマスタ光コー ド33と、反射減衰量測定用の受光素子35と、この反 射減衰量測定用の受光素子35に接続されてとの反射減 衰量測定用の受光素子の出力を測定するための第2の出 力測定器(実施例におけるパワーメータ36)と、斜め 研磨光コネクタ37とをさらに備え、前記光ファイバカ プラ32の入力端の一つには前記光コード31を介して 前記反射減衰量測定用光源30が接続され、かつ、他の 入力端には反射減衰量測定用の受光素子35が接続さ れ、前記光ファイバカプラ32の出力端の一つには前記 反射減衰量測定用のマスタ光コード33の他端が接続さ れ、かつ、他の出力端は前記斜め研磨光コネクタ37で 無反射終端され、前記反射減衰量測定用のマスタ光コネ クタ34は前記反射減衰量測定用光出力インタフェース 11aに接続され、前記反射減衰量測定用の終端部24 は、一端に低反射光コネクタ38を有し他端が斜め研磨 光コネクタ40で終端されている無反射終端光コード3 9をさらに備え、前記低反射光コネクタ38は前記反射 減衰量測定用終端インタフェース11bに接続され、前 記第1の光学特性測定器を用いて前記第1および第2の 光コネクタの接続損失と反射減衰量を自動測定すること を特徴とする光コネクタの光学特性自動測定装置とした ものである。

【0016】また、請求項2に係る発明は、前記接続損 失測定用光出力インタフェース10aと前記反射減衰量

に配置され、かつ、前記接続損失測定用受光インタフェ 一ス10bと前記反射減衰量測定用終端インタフェース 11 bとが一体となるよう配置され、一体化された前記 接続損失測定用光出力インタフェース10 a および前記 反射減衰量測定用光出力インタフェース11aと、一体 化された前記接続損失測定用受光インタフェース 10b および前記反射減衰量測定用終端インタフェース11b との機械的位置を交替させる手段をさらに具備したこと を特徴とする請求項1 に記載の光コネクタの光学特性自 動測定装置としたものである。

【0017】また、請求項3に係る発明は、前記第1, 第2の光コネクタの端面を清掃する端面クリーナ9 a. 9 b をさらに具備したことを特徴とする請求項1または 請求項2に記載の光コネクタの光学特性自動測定装置と したものである。

【0018】また、請求項4に係る発明は、前記第1の 光学特性測定器と同一構成を有する第2の光学特性測定 器をさらに有し、かつ、使用する光学特性測定器を前記 第1の光学特性測定器から前記第2の光学特性測定器 へ、あるいは前記第2の光学特性測定器から前記第1の 光学特性測定器へ機械的に切り替える手段をさらに具備 したことを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか1 項に記載の光コネクタの光学特性自動測定装置としたも のである。

[0019]

30

【作用】この発明の光コネクタの光学特性自動測定装置 では、光コードの両端に接続した光コネクタの3次元移 動が可能なロボットハンド機構により、光コネクタを自 動ハンドリングし、光学特性測定器のインタフェースに 自動挿入・抜去できるので、従来、光コードの両端に接 続した光コネクタを人手で光学特性測定器のインタフェ ースに挿入・抜去して測定していた光コネクタの光学特 性を自動測定することができる。また、光学特性測定器 のインタフェース位置を自動交替できる機能を有するの で、一式の光学特性測定器で光コードの両端の光コネク タの光学特性を測定することができる。さらに、光コネ クタのクリーナ機構を有することにより、測定対象の光 コネクタの端面を清掃することができるので、光学特性 測定の高信頼化が図れ、また、バックアップ測定系を付 加することにより、現測定系に障害が生じた時にバック アップ測定系に切り替えて測定を続行することができる ので、測定の高信頼化および装置稼働率の向上が図れ

[0020]

【実施例】図1 にこの発明の光コネクタの光学特性自動 測定装置の実施例を示す。図において、1,2は光コー ド3の両端に接続した測定対象である光コネクタ、4は 試料台、5は光コード3を収容するパレット、6a, 6 bはレセプタクル、7,8は前記光コネクタ1,2をハ <u>測定用光出力インタフェース11aとが一体となるよう</u> 50 ンドリングするロボットハンド機構、9a,9bは光コ

用し、これにマスタ光コネクタ27とマスタ光コード26とLD光源25とを接続する。一方、接続損失測定用の受光部22の接続損失測定用受光インタフェース10 bにはレセプタクル付受光素子28を配置し、パワーメータ接続コード28aを介してパワーメータ29より光出力値を読み取り接続損失測定を行う。

10

接続損失測定用光出力インタフェース、10bは接続損失測定用受光インタフェース、11aは反射減衰量測定用光出力インタフェース、11bは反射減衰量測定用終端インタフェース、10a′、10b′、11a′、11b′は予備系の測定器インタフェース、12はGPIB、13は計算機(コンピュータ)、20はターンテーブル、21,22は接続損失測定用の光出力部と受光部、23は反射減衰量測定用の光出力・受光部、26は接続損失測定用のマスタ光コード、33は反射減衰量測定用のマスタ光コード、39は無反射終端光コード、40は斜め研磨光コネクタである。

【0025】反射減衰量測定は、反射減衰量測定用の光出力・受光部23と反射減衰量測定用の終端部24を用いて行う。反射減衰量測定用光出力インタフェース11aには光コネクタ用アダプタを適用し、これにマスタ光コネクタ34と光ファイバカプラ32と光コード31としり光源30とを接続すればよい。この光ファイバカプラ32は、入力端の一つには光コード31を介して前述したLD光源30が、また、他の入力端には反射減衰量を測定するための受光素子35とパワーメータ36が接続されている。また、出力端の一つにはマスタ光コネクタ34が付いたマスタ光コード33が、また、他の出力端は斜め研磨光コネクタ37で無反射終端されている。

【0021】図1はこの発明の実施例である光コネクタの光学特性自動測定装置の全体を示した平面図、図2は同正面図であり、大別すると光コネクタのハンドリングを行う2つのロボットハンド機構および移送機構等の機構部、光学特性測定部、光学特性および機構部を制御する制御部から構成されている。光学特性の測定器としては、従来例で説明した接続損失測定器と反射減衰量測定 20 器を用いればよい。

一方、反射減衰量測定用終端インタフェース11bに は、光コネクタ用アダプタを用い、これに斜め研磨光コネクタ40で終端されている無反射終端光コード39の一端の低反射光コネクタ38を接続している。これらのインタフェースは、接続損失測定用光出力インタフェース10aと反射減衰量測定用光出力インタフェース11a、接続損失測定用受光インタフェース10bと反射減衰量測定用終端インタフェース11bがそれぞれY軸方向に積み重ねられて一体化されている。

【0022】図3に従来例と同様の構成で接続損失測定 と反射減衰量の測定器構成を示し、この発明における測 定器インタフェースを説明する。図において、21は接 続損失測定用の光出力部、22は接続損失測定用の受光 部、23は反射減衰量測定用の光出力・受光部、24は 反射減衰量測定用の終端部、25は接続損失測定用LD 光源、26は接続損失測定用のマスタ光コード、27は 接続損失測定用のマスタ光コネクタ、28はレセプタク ル付受光素子、28aはパワーメータ接続コード、29 はパワーメータ、30は反射減衰量測定用のLD光源、 31は光コード、32は光ファイバカブラ、33は反射 減衰量測定用のマスタ光コード、34は反射減衰量測定 用のマスタ光コネクタ、35は反射減衰量を測定するた めの受光素子、36はパワーメータ、37は斜め研磨光 コネクタ、38は低反射光コネクタ、39は無反射終端 光コード、40は斜め研磨光コネクタである。

【0026】図1および図2において、測定対象である 光コネクタ1,2は、光コード3の両端に取付けられて おり、光コネクタの光学特性測定は片端ずつ別個に測定 される。まず、光コネクタ1の光学特性測定について説 明する。光コード3の両端に取付けられた光コネクタ 1,2は、試料台4上に搭載されたパレット5上のレセ プタクル6a,6bに収容されている。まず、光コネク タ1,2を接続損失測定用光出力インタフェース10a と接続損失測定用受光インタフェース10bに移送する ため、ロボットハンド機構7,8はZ方向に移動し測定 対象である光コネクタ1,2の上空に位置決めされた 後、Y方向に下がり光コネクタ1,2を把持する。

【0023】光学特性の自動測定に先立ち、従来例で説明した、接続損失、反射減衰量のそれぞれの基準値を設定する必要がある。との基準値の設定は、マスタ光コネクタ27を両端に光コネクタ1、2を有する光コード3を介して接続損失測定用のレセプタクル付受光素子28に接続し、この時の値を接続損失の基準値(接続損失0)と設定し、また、反射減衰量の基準値の設定は、反射減衰量測定用のマスタ光コネクタ34を空気層にさらした状態で基準値を設定する。以上の設定を終了した後、接続損失と反射減衰量の自動測定を行う。

【0027】次に、レセプタクル6a,6bから光コネクタ1,2を取り外した後、Y方向に上昇し、接続損失測定用および反射減衰量測定用の各インタフェース10a,10b,11a,11b方向(Z方向)に光コネクタ1,2を移送する。端面クリーナ9a,9bは、ロボットハンド機構7,8に把持された光コネクタ1,2の高さまで上昇し、光コネクタ1,2の端面を清掃する。端面クリーナ9a,9bは、内部にテープ状の布を有し、光コネクタ1,2はロボットハンド機構7,8によりとの端面クリーナ9a,9bの布端面に押し付けられる。この状態で端面クリーナ9a,9b内の布が移動

【0024】接続損失の測定は接続損失測定用の光出力 し、光コネクタ1、2はロボットハンド機構7、8に 部21と受光部22を用いて行う。接続損失測定用光出 りこの端面クリーナ9a、9bの布端面に押し付けら カインタフェース10aには光コネクタ用アダプタを適 50 る。この状態で端面クリーナ9a、9b内の布が移動 し、光コネクタ1,2の端面を清掃する。光コネクタ1,2の端面の清掃後、端面クリーナ9a,9bは下降し、元の位置に戻る。

【0028】次に、光コネクタ1,2は接続損失を測定 するため、接続損失測定用光出力インタフェース10a および接続損失測定用受光インタフェース10bに挿入 ・固定される。とのロボットハンド機構7,8の移送・ 制御は、全て図示しない制御装置により行われる。複雑 な移送が不必要でかつ経済的な構成が可能なものは、ロ ボットハンド機構の移送手段にはエアシリンダが、制御 装置にシーケンサが用いられることが多い。ロボットハ ンド機構が複雑な移送を必要とする場合は、ロボットハ ンド機構の移送手段には、エンコーダ付モータが、制御 には計算機(コンピュータ)が用いられることが多い。 【0029】ロボットハンド機構7、8により光コネク タ1,2を接続損失測定用光出力インタフェース10a および接続損失測定用受光インタフェース 10 b に挿入 固定された状態において、図3に示すように接続損失測 定用のLD光源25より出射した光は、マスタ光コネク タ27を出射し、測定対象である光コネクタ1を介して 光コード3内へ伝播し、他端の光コネクタ2から出射し た光がレセプタクル付受光素子28により受光される。 とのレセプタクル付受光素子28の出力値をパワーメー タ29からGPIB12のバスを介して計算機13で読 み取ることにより光コネクタの接続損失が測定できる。 もし、複数回測定の平均値が必要であれば、ロボットハ ンド機構7により光コネクタ1を接続損失測定用光出力 インタフェース10aからの抜去、再結合を繰り返せば よい。

【0030】次に、光コネクタ1の反射減衰量を測定するため、光コネクタ1を接続損失測定用光出力インタフェース10aおよび接続損失測定用光出力インタフェース10bから抜去し、反射減衰量を測定するため光コネクタ1を反射減衰量測定用光出力インタフェース11aに、他端の光コネクタ2は反射減衰量測定用終端インタフェース11bに挿入固定する。この状態においては、反射減衰量測定用のLD光源30から出射した光は光ファイバカブラ32を伝播しマスタ光コネクタ34から出射した後、測定対象である光コネクタ1と光コード3内を伝播し、もう一方の測定対象である光コネクタ2と低反射光コネクタ38との光コネクタ接続を介して無反射終端光コード39内をさらに伝播し、最終的には斜め研磨光コネクタ40により光は、光コード39外に放射される。

【0031】従って、光ファイバカブラ32の入力端に 取付けられた受光素子35には、光コネクタ接続部での 反射光が受光され、との受光素子35の出力値をパワー メータ36からGPIB12のバスを介して計算機13 で読み取ることにより、光コネクタ1の反射減衰量が測 定できる。もし、複数回測定の平均値が必要であれば、 12

接続損失の測定と同様に、ロボットハンド機構7により 光コネクタ1を反射減衰量測定用光出力インタフェース 11aからの抜去、再結合を繰り返せばよい。

【0032】以上の作動により片端の光コネクタ1の光学特性が測定できる。次に、他端の光コネクタ2の光学特性を測定するには、光コネクタ1,2のX方向の位置を入替えて、前記の測定を繰り返せばよい。光コネクタ1,2の位置を変更する最も簡単な方法は、パレット5上に一旦光コネクタ1,2をロボットハンド機構7,8により戻した後、人手を介して入替えることであるが、この場合、一端の光コネクタの自動測定となり測定効率が悪い。ロボットハンド機構により、自動的に光コネクタの位置を入れ換えることも可能であるが、機構や作動で光コネクタの位置を変更し、他端の光コネクタの光学特性も自動的に測定する方法を説明する。

【0033】図4および図5は図1の全体構成図を2方向から見た図である。図4は光コネクタ1の光学特性を測定する場合を示したものであって、例えば光コネクタ1の接続損失を測定する場合は、ロボットハンド機構7により光コネクタ1を接続損失測定用光出力インタフェース10aに、また、ロボットハンド機構8により光コネクタ2を接続損失測定用受光インタフェース10bに挿入する。このように接続することにより、光コネクタ1の接続損失が測定できる。

【0034】次に、光コネクタ1の反射減衰量は、光コ ネクタ1を反射減衰量測定用光出力インタフェース11 aに、また、光コネクタ2を反射減衰量測定用終端イン タフェース11bに挿入することにより測定できる。以 上で片端の光コネクタ1の光学特性が測定できる。次 に、もう一方の測定対象である光コネクタ2の光学特性 を測定するため、図5に示すように、測定器のインタフ ェースをx方向に移送して入替え、さらに、光コネクタ を把持しているロボットハンド機構のy方向の高さも変 更し、もう一方の測定対象である光コネクタ2が接続損 失測定用光出力インタフェース10aおよび反射減衰量 測定用光出力インタフェース11 a と、測定対象である 光コネクタ1が接続損失測定用受光インタフェース10 b および反射減衰量測定用終端インタフェース11bと 結合させることにより前記と同様の方法に光コネクタ2 の光学特性が測定できる。従って、測定インタフェース の位置変更機構を導入することにより、両端の光コネク タの光学特性を一式の測定器で測定できる。

【0035】さらに、図3に示した測定系をもう一式用意し、この実施例で示した装置に組み込めば、測定系の2重化による高信頼測定も可能となる。図2において、10a', 11b' は予備系の測定器インタフェースであり、測定値が設定した規格値の上限値を越えた場合には、ターンテーブル20が回転

50 し、前記各インタフェース10a, 10b, 11a, 1

4

【図7】従来の反射減衰量を説明する図である。 【符号の説明】 1, 2 測定対象である光コネクタ . 3 ・ 光コード

14

b′, lla′, llb′に切り替わり再度測定を行 う。測定結果が同じ場合は、測定された光コネクタの値 が規格値を越えていることを意味し、再測定で規格値の 上限値以下であれば先の測定で使用したマスタ光コネク タの異常であることが分かる。このように測定系の2重 化を図れば、検査対象物と測定系の異常をチェックでき るので、高信頼な測定が可能となる。

[0036]

【発明の効果】との発明は、以上説明したように構成さ れているので、光コードの両端に接続した測定対象であ る光コネクタの3次元移動が可能なロボットハンド機構 により、光コネクタを自動ハンドリングし、光学特性測 定器のインタフェースに自動挿入・抜去できるので、従 来、光コードの両端に接続した光コネクタを人手で光学 特性測定器のインタフェースに挿入・抜去して測定して いた光コネクタの光学特性を自動測定することができ る。また、光学特性測定器のインタフェース位置を自動 交替できる機能を有するので、一式の光学特性測定器で 光コードの両端の光コネクタの光学特性を測定すること ができる。さらに、光コネクタのクリーナ機構を有する ことにより、測定対象の光コネクタの端面を清掃するこ とができるので、光学特性測定の高信頼化が図れ、ま た、バックアップ測定系を付加することにより、現測定 系に障害が生じた時にバックアップ測定系に切り替えて 測定を続行することができるので、測定の高信頼化およ び装置稼働率の向上が図れる。以上のように、従来人手 による測定で使用している光学特性測定器をそのまま活 用して、測定時に必要な測定インタフェースへの光コネ クタの着脱といった煩雑な作業が不要となり、さらには 30 測定器インタフェースの機械的な位置交替機構ならびに 測定系の2重化構成を導入することにより、一式の測定 系で両端の光コネクタの光学特性を高信頼に測定できる ので、従来人手による測定では困難であった測定時間の 短縮化、検査コストの低減化、信頼性の向上が図れる。 -【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の光コネクタ光学特性自動測定装置の 実施例の平面図である。

【図2】との発明の光コネクタ光学特性自動測定装置の 実施例の正面図である。

【図3】との発明の光コネクタ光学特性自動測定装置の 実施例における光学特性測定器の構成を説明する図であ

【図4】 この発明の光コネクタ光学特性自動測定装置の 実施例における測定インタフェースに位置変更を説明す る図である。

【図5】この発明の光コネクタ光学特性自動測定装置の 実施例における測定インタフェースに位置変更を説明す る図である。

【図6】従来の接続損失測定を説明する図である。

試料台、 5 パレット

6 a レセプタクル

レセプタクル 6 b

7 ロボットハンド機構

8 ロボットハンド機構 10

> 9 a 端面クリーナ

> 9 b 端面クリーナ

10 a 接続損失測定用光出力インタフェース

10 b 接続損失測定用受光インタフェース

10a' 予備系の測定器インタフェース

10b' 予備系の測定器インタフェース

lla 反射減衰量測定用光出力インタフェース

1 1 b 反射減衰量測定用終端インタフェース

lla' 予備系の測定器インタフェース

1 1 b' 予備系の測定器インタフェース 20

> 12 GPIB

13 計算機

20 ターンテープル

2 1 接続損失測定用の光出力部

22 接続損失測定用の受光部

23 反射減衰量測定用の光出力・受光部

24 反射減衰量測定用の終端部

25 接続損失測定用のLD光源

26 接続損失測定用のマスタ光コード

2 7 接続損失測定用のマスタ光コネクタ

レセプタクル付受光素子 28

28a パワーメータ接続コード

29 パワーメータ

30 反射減衰量測定用のLD光源

3 1 光コード

32 光ファイバカプラ

反射減衰量測定用のマスタ光コード 33

34 反射減衰量測定用のマスタ光コネクタ

35 受光素子

パワーメータ 40 36

> 37 斜め研磨光コネクタ

38 低反射光コネクタ

39 無反射終端光コード

40 斜め研磨光コネクタ

41 L D光源

42 マスタ光コード

42a 光コネクタ

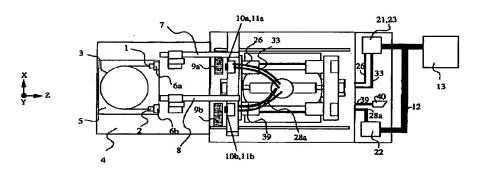
42b マスタ光コネクタ

43 アダプタ

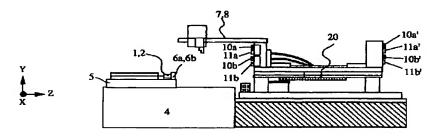
50 44 光コネクタ付きの光コード

				,,,
	1 5			16
44a	測定対象である光コネクタ	*	5 2	マスタ光コード
44 b	終端側の光コネクタ		52a	斜め研磨光コネクタ
45	受光ユニット		52b	反射減衰量の測定用のマスタ光コネクタ
46	パワーメータ	1	53 .	アダプタ
50	安定化LD光源		5 4	反射減衰量を測定するための受光ユニット
5 1	光方向性結合器		5 5	パワーメータ
51a	入力ポート	•	56	アダプタ
5 l b	入力ポート		57	光コード
51 c	出力ポート		57a	測定対象である光コネクタ
5 1 d	出力ポート	10	57b	終端側光コネクタ
51 e	入力ポート用の光コネクタ		5 8	アダプタ
5 1 f	入力ポート用の光コネクタ		5 9	無反射終端光コード
51g	出力ポート用の斜め研磨光コネクタ		59 a	低反射光コネクタ
5 1 h	出力ボート用の斜め研磨光コネクタ	*	59b	斜め研磨光コネクタ

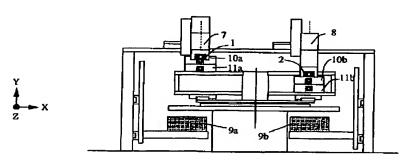
[図1]



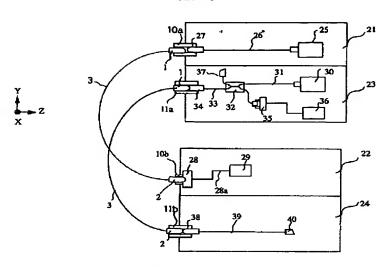
[図2]



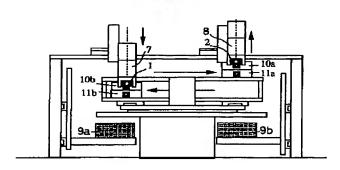
【図4】



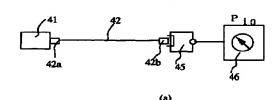


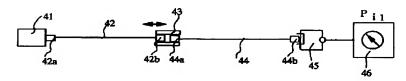


【図5】



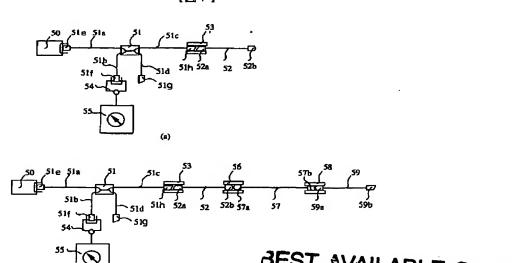
[図6]







(b)



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 平6-241945 (JP, A)

特開 平5-40074 (JP, A)

特開 昭63-241329 (JP, A)

実開 平2-105142 (JP, U)

(58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)

GO1M 11/00 - 11/02

G02B 6/00

G02B 6/36